

# Солнечные элементы на основе антимонида галлия

© В.М. Андреев, С.В. Сорокина, Н.Х. Тимошина, В.П. Хвостиков<sup>¶</sup>, М.З. Шварц

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,  
194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 27 августа 2008 г. Принята к печати 2 сентября 2008 г.)

Методами жидкофазной эпитаксии и диффузии из газовой фазы созданы различные варианты структур фотоэлементов на основе GaSb, предназначенных для использования в каскадных преобразователях солнечного излучения. Исследован узкозонный фотоэлемент (GaSb) в составе тандема на основе комбинации полупроводников GaAs–GaSb (два  $p$ – $n$ -перехода) и GaInP/GaAs–GaSb (три  $p$ – $n$ -перехода). Значения максимальной эффективности фотоэлектрического преобразования в GaSb за широкозонными элементами составляют  $\eta = 6.5\%$  (при кратности концентрирования солнечного излучения 275, для спектра AM1.5D, Low AOD).

PACS: 73.50.Pz, 81.15.Lm, 84.60.Jt

## 1. Введение

Механическистыкованные каскадные элементы (тандемы) на основе пары GaAs–GaSb впервые были созданы в 1989 году [1]. В последнее десятилетие в связи с успехами по выращиванию многослойных гетероструктур в системе  $A^{III}B^V$  методом газофазной эпитаксии из металлогорганических соединений созданы высокоеффективные двух- и трехпереходные солнечные концентраторные монолитные элементы [2–5]. Возможности дальнейшего повышения эффективности фотоэлектрического преобразования механическистыкованных тандемов связывают с введением в их состав монолитных двухпереходных элементов. Одной из наиболее перспективных модификаций такого комбинированного каскадного элемента является тандем на основе GaInP/GaAs–GaSb. За счет добавления GaSb-элемента в таких каскадных фотоэлементах возможно увеличение КПД более чем на 6%. При использовании узкозонных элементов из Ge (в монолитных трехпереходных фотоэлементах) эта прибавка составляет всего 3–4%.

В данной работе рассматриваются пути совершенствования структуры узкозонного фотоэлемента на основе GaSb, предназначенного для использования в механическистыкованных тандемных преобразователях солнечного излучения, в которых в качестве широкозонной части могут быть использованы фотопреобразователи на основе GaAs или GaInP/GaAs.

## 2. Получение фотоэлементов на основе GaSb

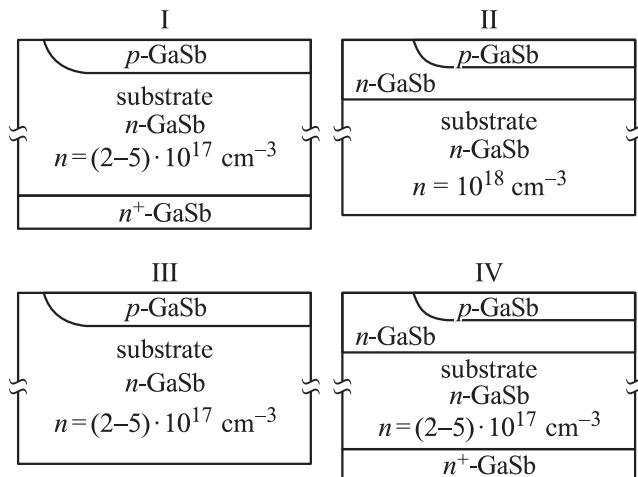
На основании представленных в [6] исследований по определению условий кристаллизации слоев GaSb из расплава, обогащенного галлием, были разработаны оптимальные режимы формирования фотоэлементной структуры методами жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ), диффузии и их комбинаций.

Структуры для фотоэлементов получали диффузией цинка как непосредственно в подложку  $n$ -GaSb [7,8], так и в эпитаксиальный базовый слой [9,10]. Эпитаксиальный рост проводился в графитовых кассетах из зазора высотой 0.5 мм в режиме охлаждения со скоростью 0.5–1.0 К/мин. Начальную температуру эпитаксии изменяли в пределах 360–510°C, при этом интервал охлаждения составлял от 10 до 40°C.

Селективность  $p$ – $n$ -перехода обеспечивалась при помощи двухстадийной диффузии цинка из газовой фазы. На первом этапе диффузииировался „мелкий“ (0.3–0.5 мкм)  $p$ – $n$ -переход (фотоактивная область элемента), а последующей диффузией  $p$ – $n$ -переход „заглублялся“ до 1.0–1.5 мкм на участках под контактной сеткой. Локальность диффузионных процессов достигалась формированием маски на поверхности подложки путем осаждения диэлектрической пленки  $Si_3N_4$  (толщиной более 0.05 мкм) или  $SiO_2$  (толщиной 0.1–0.2 мкм). На первом этапе низкотемпературной диффузии (450°C) такая защитная рамка позволяет избежать формирования  $p$ – $n$ -перехода в периферийной области элемента и, следовательно, снизить токи утечки. На втором этапе диффузии при большей температуре (470–480°C) диэлектрическая пленка  $Si_3N_4$  (с вскрытыми окнами под будущие полосковые контакты) защищает поверхность образца от повторного взаимодействия с парами цинка. Смещения диффузионной границы в фотоактивной области структуры, защищенной маской, не наблюдалось. Для предотвращения окисления подложек диффузия проводилась в непрерывном потоке водорода, очищенного через палладиевый фильтр. Использовался однотемпературный метод диффузии, т. е. источник диффузанта (чистый цинк) и подложка имели одинаковую температуру.

Тыльный омический контакт к структурам фотоэлементов формировался последовательным напылением сплава Au +12%Ge, Ni и Au. В качестве лицевых контактов использовались Cr/Au и Ti/Pt/Au (с последующим электролитическим осаждением Au на обе стороны фотоэлемента). Антиотражающее покрытие получалось последовательным напылением пленок ZnS/MgF<sub>2</sub>. Фото-

<sup>¶</sup> E-mail: vkhv@scell.ioffe.ru



**Рис. 1.** Варианты структур фотоэлементов на основе GaSb, изготовленные комбинацией ЖФЭ и диффузии.

элементы имели размеры  $3.5 \times 3.5$  мм и предназначались для преобразования концентрированного солнечного излучения в составе механически стыкованного каскада с прозрачными в инфракрасной (ИК) области широкозонными однопереходными AlGaAs/GaAs- или двухпереходными GaInP/GaAs-фотоэлементами.

Разработано четыре варианта структур узкозонных GaSb-фотоэлементов (рис. 1).

Вариант I: диффузия в подложку с тыльным эпитаксиальным слоем  $n^+$ -GaSb; уровень легирования подложки в этом случае составлял  $n = (2-5) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ .

Вариант II: диффузия в фронтальный эпитаксиальный слой  $n$ -GaSb; уровень легирования подложки  $n \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .

Вариант III: диффузия в подложку GaSb с уровнем легирования  $n = (2-5) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ .

Структура фотоэлемента по варианту IV состояла из фронтального эпитаксиального слоя с диффузионным  $p-n$ -переходом с лицевой стороны подложки (уровень легирования  $n = (2-5) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ); дополнительно с обратной стороны пластины GaSb кристаллизовался высоколегированный  $n^+$ -слой.

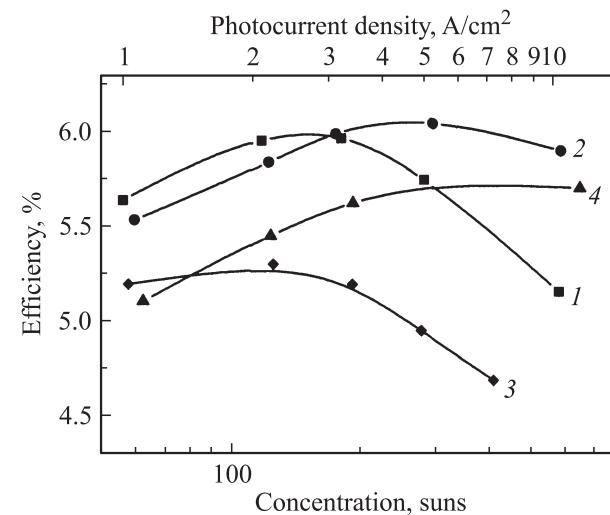
Введение в структуру фотоэлемента тыльного эпитаксиального слоя  $n^+$ -GaSb (варианты I, IV) облегчает формирование низкоомного контакта и способствует повышению фактора заполнения вольт-амперной характеристики (ВАХ) прибора. К аналогичным эффектам приводит повышение уровня легирования подложки до  $n \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$  (вариант II). Для элементов всех типов  $p-n$ -переход формировался при помощи двухстадийной диффузии цинка из газовой фазы.

### 3. Результаты исследований фотоэлементов на основе GaSb

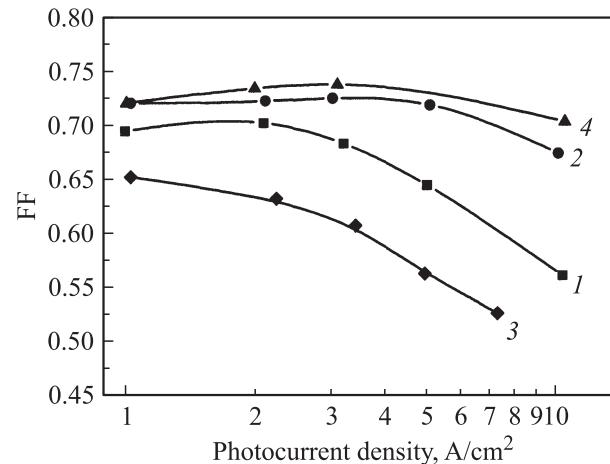
На рис. 2 представлены значения эффективности GaSb-фотоэлементов, показанных на рис. 1, в зависимости от интенсивности их освещения. Измерения прово-

дились под „верхним“ однопереходным GaAs-фотоэлементом, „прозрачным“ для излучения в области длин волн  $\lambda > 0.9$  мкм.

Как следует из рис. 2, элементы, имеющие в структуре эпитаксиальные слои (кривые 1, 2, 4), характеризуются более высокими значениями эффективности преобразования солнечной энергии по сравнению с элементом, изготовленным диффузией непосредственно в подложку GaSb (кривая 3). При этом для элементов типов I и III при плотностях фототока выше  $J \gtrsim 3 \text{ A/cm}^2$  наблюдается падение эффективности, а для элементов типов II и IV эффективность продолжает расти до  $J = 5-10 \text{ A/cm}^2$ . Этот факт можно объяснить меньшей величиной омических потерь в фотоэлементах на подложках с повы-



**Рис. 2.** Зависимости эффективности преобразования концентрированного солнечного излучения от степени концентрации для GaSb-фотоэлементов типов I–IV (1–4 соответственно). Измерения проводились за „верхним“ элементом на основе GaAs. Условия засветки: солнечное излучение спектр AM1.5D, Low AOD.



**Рис. 3.** Зависимости фактора заполнения ВАХ от плотности фототока для GaSb-фотоэлементов типов I–IV (1–4 соответственно).

Значения фототока в фотоэлементе на основе GaSb в структуре каскадного фотопреобразователя с различными „верхними“ элементами

Тип „верхнего“ элемента	Плотность фототока, мА/см <sup>2</sup>
Без широкозонного элемента	38.76
GaAs (уровень легирования подложки $n \sim 10^{17}$ см <sup>-3</sup> , толщина $d = 450$ мкм)	18.59
GaInP/GaAs (уровень легирования подложки $n = 2 \cdot 10^{16}$ см <sup>-3</sup> , толщина $d = 380$ мкм)	18.45
GaInP/GaAs (уровень легирования подложки $n = (2-5) \cdot 10^{18}$ см <sup>-3</sup> , толщина $d = 100$ мкм)	16.81
GaInP/GaAs (уровень легирования подложки $n = (2-5) \cdot 10^{18}$ см <sup>-3</sup> , толщина $d = 310$ мкм)	14.00

Примечание. Данные приведены для засветки солнечным излучением AM1.5D, Low AOD, 1000 Вт/м<sup>2</sup>.

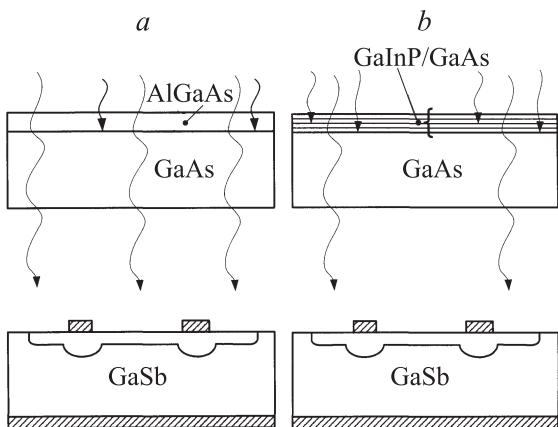


Рис. 4. Схема облучения GaSb-фотоэлементов через ИК прозрачные структуры „верхних“ солнечных элементов: *a* — однопереходная структура AlGaAs/GaAs; *b* — двухпереходная структура GaInP/GaAs.

шенным уровнем легирования или с тыльным сильно легированным слоем, о чем свидетельствуют высокие значения фактора заполнения нагрузочной характеристики ( $FF \geq 0.7$ ) для структур типов II, IV (рис. 3).

Несколько меньшие значения эффективности при высоком значении FF, полученные на элементах типа IV, можно объяснить более глубоким залеганием *p-n*-перехода в этих элементах и в связи с этим меньшей величиной фототока.

Разработанные GaSb-фотопреобразователи предназначены для работы в составе каскадных солнечных элементов с „верхними“ ИК-прозрачными элементами, выполненными на основе однопереходной структуры AlGaAs/GaAs (рис. 4, *a*) или на основе двухпереходной структуры GaInP/GaAs (рис. 4, *b*). Двухслойные антиотражающие покрытия были выполнены из ZnS/MgF<sub>2</sub> как для „нижних“, так и для „верхних“ элементов тандема, причем в „верхнем“ широкозонном элементе для уменьшения оптических потерь просветляющие пленки наносились с обеих (лицевой и тыльной) сторон.

На рис. 5 (кривая 1) приведен спектр фоточувствительности GaSb-фотопреобразователей с фронтальным базовым слоем, полученным жидкофазной epitаксией. При облучении данного фотоэлемента через гетероструктуру AlGaAs/GaAs наблюдается снижение внешнего квантового выхода в диапазоне длин волн 900–1840 нм (рис. 5, кривая 2) вследствие оптических потерь (отражение и поглощение) в „верхнем“ элементе (уровень легирования подложки  $n = 2 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>, толщина 450 мкм). При этом диапазон длин волн фоточувствительности для узкозонного фотоэлемента сужается до  $\lambda = 900$ –1840 нм за счет полного поглощения коротковолнового излучения ( $\lambda < 900$  нм) подложкой GaAs.

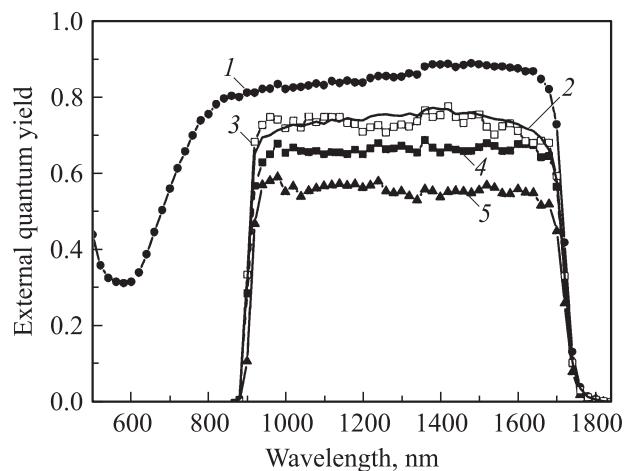
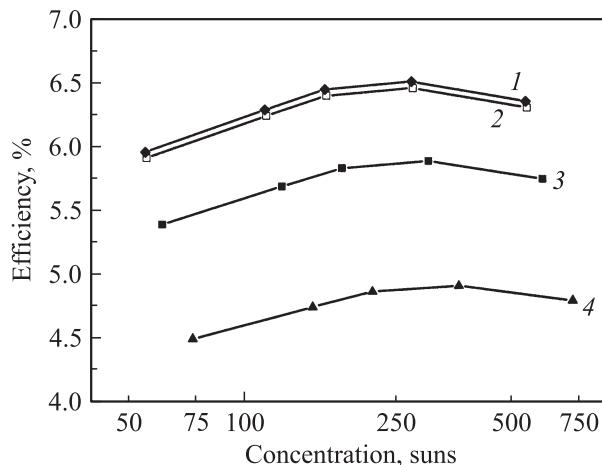


Рис. 5. Спектры внешней квантовой чувствительности GaSb-фотоэлемента: 1 — без использования широкозонных фильтров; 2 — за верхним фильтром на основе GaAs (толщина подложки 450 мкм, уровень легирования  $\sim 10^{17}$  см<sup>-3</sup>); (3—5) — за верхним фильтром на основе GaInP/GaAs. 3 — толщина подложки GaAs  $d = 380$  мкм, уровень легирования  $n = 2 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>; (4, 5) — толщина подложки  $d = 100$  и 310 мкм соответственно, уровень легирования  $n = (2-5) \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup>.



**Рис. 6.** Эффективность преобразования солнечных элементов на основе GaSb при их расположении за „верхним“ ИК-прозрачным элементом на основе GaAs (1) или GaInP/GaAs (2–4) для структур с различными уровнями легирования ( $n$ ) и толщиной подложки ( $d$ ) GaAs: 1 —  $n \sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ,  $d = 450 \text{ мкм}$ ; 2 —  $n = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ,  $d = 380 \text{ мкм}$ ; 3 —  $n = (2\text{--}5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ,  $d = 100 \text{ мкм}$ ; 4 —  $n = (2\text{--}5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ,  $d = 310 \text{ мкм}$ . Условия измерения: спектр AM1.5D, Low AOD.

Для оценки вклада узкозонного фотопреобразователя в общую эффективность тандема в паре с двухпереходным широкозонным монолитным элементом [5] были измерены значения внешнего квантового выхода в GaSb за фильтром на основе гетероструктуры GaInP/GaAs (рис. 5, кривые 3–5). В механически стыкованном тандеме меньшие оптические потери и больший фотоответ GaSb-элемента обеспечивают структуры „верхнего“ элемента с меньшими толщинами (рис. 5, кривая 4) и меньшим уровнем легирования подложки GaAs (рис. 5, кривая 3).

Приведенные в таблице значения плотности фототока в GaSb также свидетельствуют об уменьшении потерь на поглощение в „верхнем“ GaInP/GaAs-элементе с уменьшением толщины подложки GaAs от 310 до 100 мкм или уменьшением ее уровня легирования от  $(2\text{--}5) \cdot 10^{18}$  (рис. 5, кривая 5) до  $2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  (рис. 5, кривая 3). Увеличение коэффициента пропускания широкозонного двухпереходного элемента приводит к заметному повышению плотности фототока, максимальные значения которого составили  $18.45 \text{ mA/cm}^2$  для структуры GaInP/GaAs с низколегированной подложкой (рис. 5, кривая 3).

Максимальные значения эффективности преобразования солнечного излучения  $\eta = 6.45\text{--}6.5\%$  были получены в GaSb-элементах при их облучении за однопереходным элементом на основе GaAs (рис. 6, кривая 1) и за двухпереходным GaInP/GaAs-элементом (рис. 6, кривая 2).

Эффективность монолитных двухпереходных фотопреобразователей на основе GaInP/GaAs превышает 30% [5]. При объединении этих фотопреобразователей в тандем

с разработанными GaSb-фотоэлементами могут быть достигнуты суммарные значения кпд более 36%.

#### 4. Заключение

Комбинацией методов ЖФЭ и диффузии Zn из газовой фазы получены различные типы структур фотоэлементов на основе GaSb. Установлено, что максимальной эффективностью обладают фотоэлементы с эпитаксиальным фронтальным базовым слоем и диффузионным  $p\text{--}n$ -переходом. Показаны перспективы увеличения эффективности механически стыкованных тандемов с использованием GaSb-фотопреобразователей. Исследовано влияние параметров широкозонного фильтра на основе двухпереходной гетероструктуры GaInP/GaAs на спектральные характеристики и эффективность узкозонного GaSb-фотоэлемента. Максимальный вклад элемента на основе GaSb в общую эффективность тандема с GaInP/GaAs составил 6.45%. Дальнейшее увеличение кпд тандемных солнечных элементов возможно с использованием в узкозонной части каскада монолитного двухпереходного фотоэлемента (например, на основе GaInAsSb/GaSb [1]).

Авторы выражают благодарность В.М. Ландратову, С.А. Минтаирову и Н.А. Калюжному за предоставление структур двухпереходных GaInP/GaAs солнечных элементов.

#### Список литературы

- [1] L.M. Fraas, J.E. Avery, J. Martin, V.S. Sundaram, G. Girard, V.T. Dinh, T.M. Davenport, J.W. Yerkes, M.J. O'Neill. IEEE Trans. Electron. Dev., **37** (2), 443 (1990).
- [2] R.R. King, D.C. Law, K.M. Edmondson, C.M. Fetzer, G.S. Kinsey, H. Yoon, R.A. Sherif, N.H. Karam. Appl. Phys. Lett., **90**, 183 516 (2007).
- [3] M.W. Wanlass, S.P. Ahrenkiel, D.S. Albin, J.J. Carapella, A. Duda, K. Emery, J.F. Geisz, K. Jones, Sarah Kurtz, T. Moriarty, M.J. Romero. Proc. Int. Conf. on Solar Concentrators for the Generation of Electricity or Hydrogen (Scottsdale, Arizona, 2005).
- [4] A.W. Bett, F. Dimroth, G. Siefer. In: *Concentrator photovoltaics*, ed. by A.L. Ligue, V.M. Andreev (Berlin, Springer, 2007) [Springer Series in Optical Sciences, v. 130, p. 67].
- [5] В.М. Ландратов, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, Н.Х. Тимошина, М.З. Шварц, В.М. Андреев. ФТП, **41** (6), 751 (2007).
- [6] В.П. Хвостиков, С.В. Сорокина, Н.С. Потапович, О.А. Хвостикова, А.С. Власов, Е.П. Ракова, В.М. Андреев. ФТП, **42** (10), 1198 (2008).
- [7] V.M. Andreev, L.B. Karlina, A.V. Kazantsev, V.P. Khvostikov, V.D. Rumyantsev, S.V. Sorokina, M.Z. Shvarts, Proc. 1st Word Conf on Photovoltaic Energy Conversion (Hawaii, 1994) p. 1721.
- [8] V.M. Andreev, V.D. Rumyantsev, L.B. Karlina, A.B. Kazantsev, V.P. Khvostikov, M.Z. Shvarts, S.V. Sorokina. Proc. 4th Eur. Space Power Conf. (Poitiers, 1998) p. 363.

- [9] M.Z. Shvarts, V.M. Andreev, V.P. Khvostikov, V.R. Larionov, V.D. Rumyantsev, S.V. Sorokina, V.I. Vasil'ev, A.S. Vlasov, O.I. Chosta. *Proc. 5th Eur. Space Power Conf.* (Tarragona, 1998) p. 527.
- [10] В.П. Хвостиков, М.Г. Растегаева, О.А. Хвостикова, С.В. Сорокина, А.В. Малевская, М.З. Шварц, А.Н. Андреев, Д.В. Давыдов, В.М. Андреев. ФТП, **40**(10), 1275 (2006).
- [11] V.M. Andreev, V.P. Khvostikov, S.V. Sorokina, M.Z. Shvarts, V.I. Vasil'ev. *Proc. 14th Eur. Photovoltaic Solar Energy Conf. and Exhibition* (Barcelona, 1997) p. 1763.

Редактор Л.В. Шаронова

## Solar cells based on gallium antimonide

V.M. Andreev, S.V. Sorokina, N.K. Timoshina,  
V.P. Khvostikov, M.Z. Shvarts

Ioffe Physicotechnical Institute,  
Russian Academy of Sciences,  
194021 St. Petersburg, Russia

**Abstract** Different types of GaSb-based solar cells intended for application in cascade converters have been created by the liquid phase epitaxy technique and diffusion from the gas phase. Being a part of the tandem based on GaAs–GaSb (two  $p-n$ -junctions) and GaInP/GaAs–GaSb (three  $p-n$ -junctions), a narrow-bandgap solar cell (GaSb) has been investigated. The photovoltaic conversion efficiency of 6.5% in GaSb behind the wide-bandgap cell has been achieved at the sunlight concentration ratio of 275 for the spectrum AM1.5D, Low AOD.